⑷　納入期限　上記１⑵の件名ごとに次のとおりとする。
ＡＤ　平成25年３月29日
ＢＧ　平成25年２月28日
Ｃ　平成25年２月15日
Ｅ　平成25年３月７日
Ｆ　平成25年３月15日
Ｈ　平成25年３月20日
⑸　納入場所　上記１⑵の件名ごとに次のとおりとする。
ＡＢＣ　東京大学工学部
Ｄ　東京大学浅野キャンパス
ＥＧ　東京大学生産技術研究所
Ｆ　東京大学医科学研究所
Ｈ　東京大学先端科学技術研究センター
⑹　入札方法　上記１⑵の件名ごとにそれぞれ入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

２　競争参加資格
⑴　国立大学法人東京大学の契約事務取扱規程第２条及び第３条の規定に該当しない者であること。
⑵　入札者の競争参加資格　国の競争参加資格（全省庁統一資格）において平成24年度に関東・甲信越地域の「物品の製造又は物品の販売」のＡ、Ｂ又はＣ等級に格付けされている者であること。
⑶　購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。
⑷　製造物品に関する技術水準が高く、かつ製造実績があることを証明した者であること。
⑸　国立大学法人東京大学の契約事務取扱規程第４条の規定に基づき、総長が定める資格を有する者であること。
⑹　総長から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

３　入札書の提出場所等
⑴　入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先
〒113―8654 東京都文京区本郷７－３－１
東京大学本部契約課　高橋　　元　電話03―5841―2148
⑵　入札説明書の交付方法　本公告の日から上記３⑴の交付場所にて交付する。
⑶　入札書の受領期限　平成24年10月15日17時00分
⑷　開札の日時及び場所　上記１⑵の件名ごとに次のとおりとする。
Ａ　平成24年10月31日14時00分　東京大学本部棟３階入札室
Ｂ　平成24年10月31日15時00分　東京大学本部棟３階入札室
Ｃ　平成24年11月６日14時00分　東京大学本部棟３階入札室
Ｄ　平成24年10月30日14時00分　東京大学本部棟３階入札室
Ｅ　平成24年11月６日15時00分　東京大学本部棟３階入札室
Ｆ　平成24年11月12日14時00分　東京大学本部棟３階入札室
Ｇ　平成24年10月30日15時00分　東京大学本部棟３階入札室
Ｈ　平成24年10月30日16時00分　東京大学本部棟３階入札室

４　その他
⑴　契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
⑵　入札保証金及び契約保証金　免除
⑶　入札者に要求される事項　この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に本公告に示した物品を納入できることを証明する書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、総長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
⑷　入札の無効　本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札説明書による。
⑸　契約書作成の要否　要。
⑹　落札者の決定方法　本公告に示した物品を納入できると総長が判断した入札者であって、国立大学法人東京大学の契約事務取扱規程第11条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
⑺　手続における交渉の有無　無
⑻　その他　詳細は、入札説明書による。

５　Summary
⑴　Official in charge of disbursement of the procuring entity : Junichi Hamada, President of the University of Tokyo
⑵　Classification of the products to be procured : 24
⑶　Nature and quantity of the products to be purchased :
A　Multi Channel Detector for Scanning Transmission Electron Microscope 1 Set
B　High temperature heating stage with tensile function 1 Set
C　X-ray Photoelectron Spectrometer 1 Set
D　Micro-Raman imaging system 1 Set
E　Dry Etch System for Si semiconductor nano structures 1 Set
F　Isothermal Titration Calorimetry 1 Set
G　Dry etching system for Compound semiconductor nano structures 1 Set
H　Power conversion system of Blow-Hole wave power generator for verification test 1 Set
⑷　Delivery period :
ＡＤ　By 29, March, 2013
ＢＧ　By 28, February, 2013
Ｃ　By 15, February, 2013
Ｅ　By 7, March, 2013
Ｆ　By 15, March, 2013
Ｈ　By 20, March, 2013
⑸　Delivery place :
ＡＢＣ　Faculty of Engineering The University of Tokyo
Ｄ　Asano Campus, The University of Tokyo
ＥＧ　Institute of Industrial Science, The University of Tokyo
Ｆ　The Institute of Medical Science, The University of Tokyo
Ｈ　Research Center for Advanced Science and Technology, The University of Tokyo
⑹　Qualifications for participating in the tendering procedures : Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who shall :
A　not come under Article 2 and 3 of the Regulation concerning the Contract for the University of Tokyo,
B　have the Grade A, Grade B or Grade C qualification during fiscal 2012 in the Kanto-Koshinetsu area in manufacture of product or sales of product for participating in tenders by Single qualification for every ministry and agency,
C　prove to have prepared a system to provide rapid after-sale service and maintenance for the procured products,
D　prove to keep a high technological level and have actually manufactured the products concerned,
E　meet the qualification requirements which President of the University of Tokyo may specify in accordance with Article 4 of the Regulation,
F　not be currently under a suspension of business order as instructed by President of the University of Tokyo,
⑺　Time limit of tender : 5 : 00 PM 15, October, 2012
⑻　Contact point for the notice : Hajime Takahashi, Contract Group, the University of Tokyo, 7―3―1 Hongo Bunkyo-ku Tokyo 113―8654 Japan, TEL 03―5841―2148